

平成 21 年 1 月 28 日

教職員各位

ものづくり基盤センター ものづくり基盤技術研究部門 報告会のご案内

標記報告会を下記のとおり開催いたしますので、ぜひご参加願います。

記

日 時：2月17日(火) 14時～

場 所：S201室(共同利用施設2F)

プログラム

14:00-14:05 センター長挨拶

14:05-14:35 シリカ材料表面微細加工プロセスとデバイスへの応用

電気電子工学科 教授 福田 永 氏

14:35-15:05 マイクロ波励起表面波プラズマ処理装置の自己無撞着解

析のための空洞Q値に関する考察について

電気電子工学科 准教授 川口 秀樹 氏

教授 鏡 慎 氏

15:05-15:35 低剛性部品の高精度切削加工

機械システム工学科 准教授 寺本 孝司 氏

15:35-16:05 最新の鋳造技術 -凍結鋳型鋳造法-

ものづくり基盤センター 准教授 清水 一道 氏

(問合せ先)

電気電子工学科 佐藤 孝紀